## 科学研究費助成事業

\_ . . \_

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):本研究にて開発した実験装置と条件にて、カソードへの粒子の取込みを再現できることを確認した。大きな凝集体の上にコブが生成することを明らかにした。流動を強くすると析出する銅の結晶粒が細かくなり平滑になった。A1203 粒子に比べて Ag 粒子は取り込まれやすいこと、Ag 凝集体が取り込まれると、それを起点として結晶粒は扇状に成長し、コブを生成しやすいことを明らかにした。凝集体の取込みの抑制には、十分な強さの流動が有効であることが示された。

研究成果の概要(英文): The experimental apparatuses and conditions developed in this research were confirmed to reproduce the engulfment of particles into cathode. The nodules were clearly formed on the large agglomerated particles. Increasing the fluid intensity decreased the size of crystalline grains of copper and improved the flatness of deposition surface. It was made clear that, compared to the Al203 particles, the Ag particles were easier to be engulfed and the agglomerate was easier to become origin of radial growth of copper crystals, leading to the nodule. It was shown that higher intensity of flow is effective to suppress the engulfment of the agglomerates.

研究分野: 金属製錬工学

キーワード : 金属生産工学 素材精製 電解精製 モデル化 銅製錬 スライム 析出形態 電解液流動

1.研究開始当初の背景

銅製錬では精鉱やリサイクル物を原料と して生活や産業に必要な銅を生産するとと もに、貴金属やレアメルなどの各種元素を分 離回収している。電解精製工程においては、 前工程である乾式製錬工程にて製造した粗 銅(銅濃度 99.5% 程度) をアノードとして、 硫酸酸性溶液中にて電気分解を行うことで、 カソード側に電気銅(銅濃度 99.99%) を得て いる。銅以外の元素の挙動は以下の3 つに大 別され濃縮される。(1) 銅より貴な元素はア ノードにおいて酸化溶解されないので、微粒 子となって電解槽底部に沈降し陽極泥(アノ ードスライム)を形成する。金、銀、白金、 ロジウム、パラジウム、ルテニウム、セレン、 テルルなどが上げられる。なお、硫酸浴中で 鉛は溶解度の低い硫酸鉛を形成するためス ライムとなる。(2) 銅より卑な元素は電解液 に酸化溶解するが、カソードでは還元析出し ないので、電解時間の増加とともに電解液に 濃縮する。鉄、ニッケル、亜鉛が上げられる。 (3) 酸化還元電位が銅に近い元素は、アノー ドにてスライムと電解液の両方に分配され、 電解液に溶解した一部はカソードにて還元 析出することになる。ヒ素、ビスマス、アン チモンが上げられる。

銅電解精製では、上に記載したように、銅 以外の元素が共存する環境から純度の高い 銅を析出させることだけでなく、共存元素を 濃縮させ回収することも重要である。

最近では、鉱石事情の悪化等により銅以外 の元素濃度の高い原料を取り扱う必要があ り、また、生産性やエネルギー効率を向上さ せるために、より厳しい条件での操業を行っ ている。例えば、種板電解を必要としない不 溶性のカソード母板(パーマネントカソード) を用いた操業が行われ、アノードとカソード との間隔を一定にして電流密度分布を均一 にすることで、高電流密度化による生産性の 向上やアノード-カソード間隔の減少による エネルギー効率の向上が行われている。この ような操業によって、従来から指摘されてい る(1) アノードにおける不動態化、(2) カソー ドにおける析出状態の悪化や不純物濃度の 上昇、の問題が益々顕著になってきている。

これらの問題にたいして、電解液を流動さ せることで、アノード表面における硫酸銅濃 度の上昇を抑制したり、カソード表面におけ る銅イオン濃度の低下を抑制することがで き、問題の抑制にとって有効である。実操業 においては銅や不純物また添加剤の濃度を 一定にするために電解液を還流させている ものの、1 電解槽当たり 50 対程度の電極が あり、電極面積が 1m×1m 程度と広いのに たいして極板間は 30mm 程度と狭いため、 極板付近の液を十分には撹拌できていない。 すなわち、電極間においては、電解に伴って 銅イオン濃度の分布に起因する密度対流が 発生し、その流動による物質移動[1] に頼っ ているのが現状である。より積極的な電解液 の撹拌による物質移動の促進が期待される。

実際に強制流動を付与することで、高い電 流密度においても不動態化を抑制し、平滑な カソードが得られることが実験的に示され ている[2] [3]。我々も強制流動によって現行 より1桁高い電流密度で電解できることを 見出し[4]、水モデル[5] および数値計算[6] によって撹拌の有効性を示してきた。

一方、撹拌を行った場合に危惧されている こととして、アノードで生成するスライムの カソードへの取込みによるカソード純度の 低下および貴金属の回収率の低下、さらには、 付着したスライムによってコブ状析出物[7] が生成され電流効率が低下することが上げ られる。しかしながら、スライムの生成挙動 についても組成のみで単純には整理できな い複雑な現象であり[8]、また、粒子の取込み 過程については分散メッキを対象に行われ た研究成果[9] があるものの、銅電解精製へ の適用性については不明である。すなわち、 アノードスライムのカソードへの取込みや それによるコブ状析出物の生成については 操業因子と対応した定量的なデータは示さ れておらず、抑制指針が不明であるといえる。 参考文献

[1] "Turbulent natural convection along a vertical electrode", K. Denpo, S. Teruya,Y. Fukunaka and Y. Kondo : Metall. Trans. B, Vol.14B, (1983), pp.633-643.

[2] "Electrolytic Copper Refining at High Current Densities", S.J. Wallden, S.T. Henriksson and S.T. Arbstedt : JOM, Vol.11, No.8, (1959), pp.528-534.

[3] "High Current Density Copper Electrorefining", R. Winand and P. Harlret : Trans. Instn. Min. Metall, Vol.101, (1992), C33-C34.

[4] "銅の高電流密度電解精製における5族 元素(As, SB, Bi)の挙動に及ぼす電解液流動 の影響",高須登実男,中村崇,伊藤秀行,野 口文男,村部純一郎:資源と素材, Vol.115,(1999), pp.841-846.

[5] "Fluid Motion Characteristics with Gas Injection for Copper Electrorefining at High Current Density", Y. Hanada, H. Itou, T. Takasu : Proceedings of the Copper 2007 International Conference-Vol.V [METSOC], (2007), pp.519-532.

[6] "Numerical Simulation of Mass Transfer in Copper Electrorefining with Gas Injection", Y. Hanada, T. Takasu, H. Itou : Proceedings of the third International Conference on Processing Materials for Properties [TMS], (2009), pp.729-736.

[7] "A mineralogical study of nodulated copper cathode", J.E. Dutrizac and T.T. Chen : Proceedings of the Copper99 International Conference-Vol.III [TMS], (1999), pp.383-401. [8] "銅電解精製における不純物の挙動",小 山和也:資源・素材学会平成25年度春季大 会研究・業績発表講演会、春季大会講演 集,(2013), pp.9-12.

[9] "ニッケル-アルミナ分散メッキにおける アルミナ粒子の析出挙動", 増子昇, 虫明克 彦:金属表面技術, Vol.31, (1980), pp.523-528.

2.研究の目的

銅電解精製において電解液の流動により 銅イオンの物質移動を促進させれば、アノー ドの不動態化の抑制、カソードの平滑化や純 度向上が可能であるが、実操業には適用され ていない。その主因は、アノードで生成する スライムのカソードへの取込みによるカソ ード純度の低下および貴金属の回収率の低 下、さらには、付着したスライムによってコ ブ状析出物が生成され電流効率が低下がす ることが危惧されるためと考えられる。そこ で、本研究では、カソードへの粒子の取込み とそれに起因するコブ状析出物の生成につ いて、模擬スライム粒子を用いた実験を実施 し、各種因子の影響を学術的に明らかにする ことで、これらの問題を抑制するための方法 についての指針を示すことを目的とした。

3.研究の方法

本研究では、主に2 種類の電解実験装置を 開発して実験を行った。

1 つは円筒電解槽の低部をカソードとし て、その上部に撹拌子を設置したものである。 図1 に実験装置の模式図を示す。カソードに は3 mm 厚の無酸素銅 C1020 (20 mm × 20 mm) を用いた。カソードとガラス管(内径 16.4 mm) の間にシリコンシートを入れ、ボルトとナッ トで締めることで密封し電解セルとした。作 用面が上を向くようにカソードを配置した。 アノードにはパイプ状に加工したタフピッ チ銅板(16 mm)を用いた。参照電極には、 電気用銅線( 1.6 mm)の先端部の被覆部を 10 mm 取り除いたものを用いた。撹拌にはガ ラス棒(5 mm) に2 mm 厚の撹拌翼(5 mm×7 mm) 2 枚を取り付けたものを用いた。電解液 組成を銅濃度 40 g/L 、遊離硫酸濃度 180 g/L とし、電解液量を 20mL 、液温度を 60 に設 定した。電流密度は 400 A/m<sup>2</sup> で、理論析出 厚さが 0.5 mm となるように時間を設定して 電解を行った。撹拌速度は0,300,600,1200 rpm の4 つの条件で行った。プロペラの位置 は 1200 rpm ではカソードから 3 mm 離れた場 所にし、それ以外では10mm 離れた場所に設 置した。添加した模擬スライム粒子は Ag( 3~45µm)とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( 5~50µm)の2種類 で、粒子による投影面積を計算し、カソード 電極表面の被覆率が約 30 % になるように Ag では13 mg、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> では5 mg を量り取り、カ ソード上に設置した。電解液を入れた後、撹 拌を開始する前に粒子がカソード上になる べく均一になるようにした。マイクロチュー ブポンプでアノード室からカソード室へ液 を一定の速度で供給した。その後、撹拌を開

始し電解を行った。また、模擬スライム粒子 を添加しない実験も行った。電解後のカソー ド表面を 3D-SEM で撮影した後、樹脂埋めし ダイヤモンドカッターを用いて切断した。断 面を研磨後、6.57 M HNO<sub>3</sub> でエッチングをし、 光学顕微鏡でカソード電極の断面状態を撮 影した。



もう1 つの電解実験装置では、矩形電解槽 の側壁に電極を設置するもので、外部に粒子 を懸濁させるための分散槽を設置し液を循 環させた。図2 に実験に用いた電解セルの模 式図を示す。カソードには 1.5 mm 厚の SUS316 (15 mm×15 mm) を用いた。アノード には 2 mm 厚の無酸素銅板 C 1020 (15 mm× 15 mm) を用いた。参照電極には芯線 1.6mm の電気用銅線の被覆部を10mm 取り除いたも のを用いた。電解液組成は Cu 40 g/L、遊離 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 180 g/L とし、電解液量 500 mL、液温 度 60 、電流密度 400 A/m<sup>2</sup> として、電解時 間は析出厚さが0.5mm となるように33.9ks として定電流電解を行った。添加模擬スライ ム粒子として、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (1~44µm以下)、Ag(3 ~44 µm 以下)の2 種類を用い、体積を等し くするよう(体積添加率 2.5x10<sup>-2</sup>vol%) に Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を0.5g、Agを1.3g量り取り、電 解液に添加した。電解液の流量を小型耐薬ギ アポンプで制御し、電解液セル中の平均流速 を 60 mm/s と 90 mm/s の 2 条件とした。 電 解セルに電解液を流し始めると、電解液温度 は下がるため、電解液を流し始めてから 10 分程度液を循環させ、電解を行った。電解終 了後、カソード表面から電析物を剥離させ、 表面を観察した後、冷間樹脂埋めし、切断後 に断面を研磨し観察した。Ag 粒子添加の場 合、析出層の膜厚が薄かったため剥離をせず、 カソード基板ごと樹脂埋めし、断面観察した。 Ag 粒子を添加した電解実験では、電解後の 溶液中の Ag 濃度を原子吸光分光光度計で測 定した。



図2. 循環流動型の電解実験装置の模式図.

## 4.研究成果

(1) 撹拌子流動型装置を用いた実験結果

本実験系では撹拌子の回転によって、中央 で上昇流が、端部で下降流が生ずる。そのた め、電極表面では端部と中央部において淀み 域が形成される。回転数による電極表面での 粒子の状態を表1に示す。×は粒子が常駐し ている状態、は動いている状態、〇は存在 しない状態を示す。端部においては、全ての 条件において粒子の常駐が見られた。中心部 と中心部周辺では、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の場合には、600rpm で粒子が常駐せずに表面で動いている様子 が観察されず、液に分散していた。Agの場合 には、600 rpm でも粒子が常駐しており、1200 rpm で液に分散することがわかった。

表 1. 電極	凾表面での料	立子の分散状態	態.
---------	--------	---------	----

	回転数 (rpm)		
端部	300	600	1200
$Al_2O_3$	×	×	×
Ag	×	×	×
中心部周辺	300	600	1200
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	×	Δ	0
Ag	×	×	0
中心部	300	600	1200
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	×	Δ	0
Ag	×	×	0

図3 に電解後のカソード表面写真を示す。 添加なしの場合、0 rpm ではカソード表面 に小さな凹凸があったが、コブと呼べるほど 大きなものはなく平滑といえる。300 rpm で はカソード表面の小さな凹凸もなくなり、さ らに平滑化した。銅の析出表面の結晶粒の大 きさは0,300,600,1200 rpm の順で小さ くなっていた。

A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子添加の場合、0 rpm ではカソー ド表面に凹凸が多数あったが、カソード表面 に均一になるように置いたためマクロで見 ると平滑となっていた。SEM 画像をみると表 面の粒の大きさが 250µm と析出厚さの半分 のサイズとなっていた。300 rpm では中心部 と端部に粒子が集まり小さなコブが出来て いた。600 rpm では電解中に中心部と端部に 粒子が集まっていたがコブは出来ていなか った。これは撹拌速度が高くなったことによ り、A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子がカソードに取り込まれない 速度で動いていたためだと考えられる。1200 rpm では粒子がカソード表面に常駐する様 子は見られず、析出表面は平滑となっていた。 Ag 粒子添加の場合、0 rpm では電解前に 大きな粒子が存在していた場所にコブが出 来ていた。SEM 画像をみると表面の粒の大き さは 500 µm で析出厚さと同等のサイズとな っており、Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> より大きなコブができてい た。300 rpm では粒子が中心部と端部に集ま リコブが多数出来ていた。粒子が表面に存在 していない部分にはコブはなく、平滑となっ ていた。600 rpm では平滑な析出面が多くな っていた。また 300 rpm のときよりもコブの 数は減っていた。1200 rpm では電解中 Ag 粒 子はカソード表面から離れ電解液中を舞っ ていたが、電解が進むに連れカソード表面に Ag 粒子が引っ付きコブが出来ていた。しか し、コブの大きさはそれほど大きくなかった ため流速を上げることでコブの抑制が起き ると考えられる。

また撹拌速度を上げることでコブの表面 も平滑になっていた。またどちらの模擬スラ イム粒子を添加していても流速が高く模擬 スライム粒子が常駐しない場所では添加な しの場合と同じ析出が起こっていると考え られる。



図3. 電解後のカソード表面.

図 4 に電解後のカソード中心部の断面状態 を示す。添加なしの場合、結晶粒は初期カソ ード面に垂直な方向に成長していた。0 rpm ではカソード表面に小さな凹凸があったが、 コブと呼べるほど大きなものはなかった。撹 拌速度を高くすればするほど、結晶粒が小さ くなっていき銅の析出表面の凹凸は小さく なり平滑化した。

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 添加の場合、結晶粒は添加無しの場 合と同様に初期カソード面に垂直な方向に 成長していた。これは Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> は非導電性であ り、粒子の表面には析出しないためだと考え られる。また粒子周りの析出に巻き込まれて カソード中に取り込まれていると考えられ る。0 rpm ではカソード表面に凹凸が多数あ ったが、カソード表面に均一になるように置 いたためマクロで見ると平滑となっていた。 母板と析出層の間に Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子が入っている 穴があった。穴の大きさは 100 µm ほどのも ので Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の粒子径よりも大きいため粒子が 集まってできていると考えられる。300 rpm では粒子が集まっていた場所に小さなコブ ができていた。600 rpm では電解中に中心部 と端部に粒子が集まっていたがコブはでき ていなかった。これは撹拌速度が高くなった ことにより、AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子がカソードに取り込 まれない速度で動いていたためだと考えら れる。1200 rpm では粒子がカソード表面に 常駐する様子は見られず、析出表面は平滑と なっていた。また 600 rpm と 1200rpm の条 件では電解後の液中に取り込まれなかった AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子が存在していた。

Ag 粒子添加の場合、結晶粒は大きな Ag 粒 子が取り込まれている部分では扇状に成長 していた。0 rpm では電解前に大きな粒子が 存在していた場所にコブができていた。 300rpm では粒子が中心部と端部に集まりコ ブができていた。中心部のコブは 1 mm ほど の大きさまで成長した。粒子が存在していな い部分にはコブはなく平滑となっていた。 600rpm では 300 rpm のときより平滑な析出 面が多くなりコブの数も減少した。1200 rpm では Ag 粒子はカソード表面から離れて液中 に分散していた。そのためコブは生成されな いと考えていたが、いくつか不規則な場所に できていた。しかし他の撹拌速度と比べて小 さいコブとなっていたため、流速を上げると コブが大きくなることを抑制できる傾向が あると考えられる。また析出層のかなり上に Ag 粒子が取り込まれていることがわかる。 このことから Ag 粒子は Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子とは違い 流動下でも取り込まれやすいと考えられる。 また 300 rpm や 600 rpm のとき Ag 粒子が凝 集していた場所には析出前のカソード電極 表面との間に空洞ができていた。この空洞は 撹拌により巻き上げられ凝集した Ag 粒子の 中に電解液が巻き込まれ、Ag 粒子の上から Cu が析出し覆われたことでできたと考え られる。



図4. 電解後のカソード中心部の断面状態.

(2) 循環流動型装置を用いた実験結果

図 5 に電解後のカソード表面の光学顕微 鏡観察と SEM 観察の結果を示す。添加粒子な しと Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子の場合、流速の高い方が表面 の平滑性の高いことがわかる。添加粒子なし と Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子を比較すると、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子添加の 方が表面に析出した粒は大きかった。Ag 粒 子を添加した場合、他の条件と析出形態が大 きく異なり、カソード表面のランダムな場所 からデンドライト状の析出物が生成された。



図5. 電解後のカソード表面.

図 6 に電解後のカソード断面の光学顕微 鏡観察結果を示す。切断断面から、添加の有 無に関わらず、流速が高くなると表面の凹凸 が少なくなっていた。硝酸を用いてエッチン グを行い、カソード断面を観察すると、添加 粒子なしと AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子添加の場合は結晶粒の 形状が大きく異なっていた。添加無しの場合 は、基板から垂直方向に伸びる結晶の形状を しているが、AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子添加の場合は粗大で ランダムな形をしていた。結晶粒が粗大化し た要因は現状では不明である。Ag 粒子添加 の場合は、デンドライト状の析出が観察され た。基板と電析物の間に空隙が発生し、電析 物と基板の界面も粗くなっていた。



## 図 6. 電解後のカソード断面.

図7 にAg 粒子添加した場合の電解中のカ ソード表面の経時変化を示す。0 ks の時点 でカソード表面に Ag 凝集体が付着している ことが確認された。また、時間が経つと共に、 0 ks で付着した粒子を起点にデンドライト 状の析出物の成長が起こっていた。電解中の カソード表面観察では、電解液中を舞ってい る粒子がデンドライト状析出物にぶつかり、 付着することが確認された。したがって、デ ンドライト状の析出物は電析と粒子の取り 込みによって成長していると考えられる。



図 7. Ag 粒子添加した場合の電解中のカソ ード表面の経時変化(60 mm/s).

図8 に Ag 凝集体のカソードへの付着の様 子を捉えた写真を示す。0.3mm 程度の Ag 凝 集体がカソードに付着し、そのまま取り込ま れる様子が確認できた。



図 8. Ag 凝集体のカソードへの付着 (60mm/s).

図9 に Ag 粒子を添加した場合のカソード 断面の SEM 画像を示す。(a) に示す SEM 画像 でデンドライト状析出物付近を観察すると、 析出物中に白色の部分が確認できた。EDS 測 定を行ったところ、デンドライト析出物中に Ag 凝集体の存在が確認された。(b)に示すデ ンドライト析出物とカソード界面は、デンド ライト状析出が直上に存在しない界面にく らべ、粗くなっていることが確認された。粗 くなっているところには、Ag 凝集体が存在 すると予測したが、EDS 測定を行ったところ、 Cu であることが確認された。



図 9. Ag 粒子添加した場合の断面 SEM 画像.

電解後の溶液を 0.2µm のメンブレンフィ ルターでろ過し、ろ液の Ag 濃度を原子吸光 分光光度計で測定した。Ag 濃度は58 ppm で あった。Ag 粒子の溶解は、分散槽で大気か ら導入された溶存酸素による酸化溶解であ ると考えらえる。溶存 Ag はカソードにおい て一部還元析出することで、カソード析出形 態に影響したものと思われる。

図 10 に AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子を添加した場合のカソ ード表面と断面の SEM 観察結果を示す。表面 観察の結果、流速に関わらず、1~5µm 程度 の AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子の付着が確認された。断面観察 の結果、電析物の断面に 10µm 以下の黒色部 が確認され、その付近の EDS 測定を行ったと ころ、AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子の存在が確認できた。この ことから、今回の実験条件において、電析物 中に AI<sub>2</sub>0<sub>3</sub> 粒子が取り込まれることが確認さ れた。



図 10. AI<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子を添加した場合のカソード 表面と断面の SEM 画像.

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[学会発表](計 2件)

永嶋和樹、仁志裕一郎、<u>高須登実男、伊藤秀行</u>、銅電解精製における模擬スライム粒子のカソードへの取込みに及ぼす液流動の影響、日本金属学会・鉄鋼協会九州支部材料プロセス談話会、2017年3月10日、九州大学(福岡県福岡市). (こ志裕一郎、石飛秀士、<u>高須登実男、伊藤秀行</u>、銅電解精製のカソード析出に及ぼす模擬スライム粒子の影響、資源・素材学会九州支部平成27年度若手研究者および技術者の研究発表会講演要旨集、pp.13-15、2015年6月12日、九州大学(福岡県福岡市).

- 6.研究組織
- (1)研究代表者
  高須 登実男(TAKASU, Tomio)
  九州工業大学・大学院工学研究院・准教授
  研究者番号: 20264129

(2)研究分担者
 伊藤 秀行(ITOU, Hideyuki)
 九州工業大学・大学院工学研究院・助教
 研究者番号: 90213074